

# 半導体製造装置の床振動測定

## ～概要～

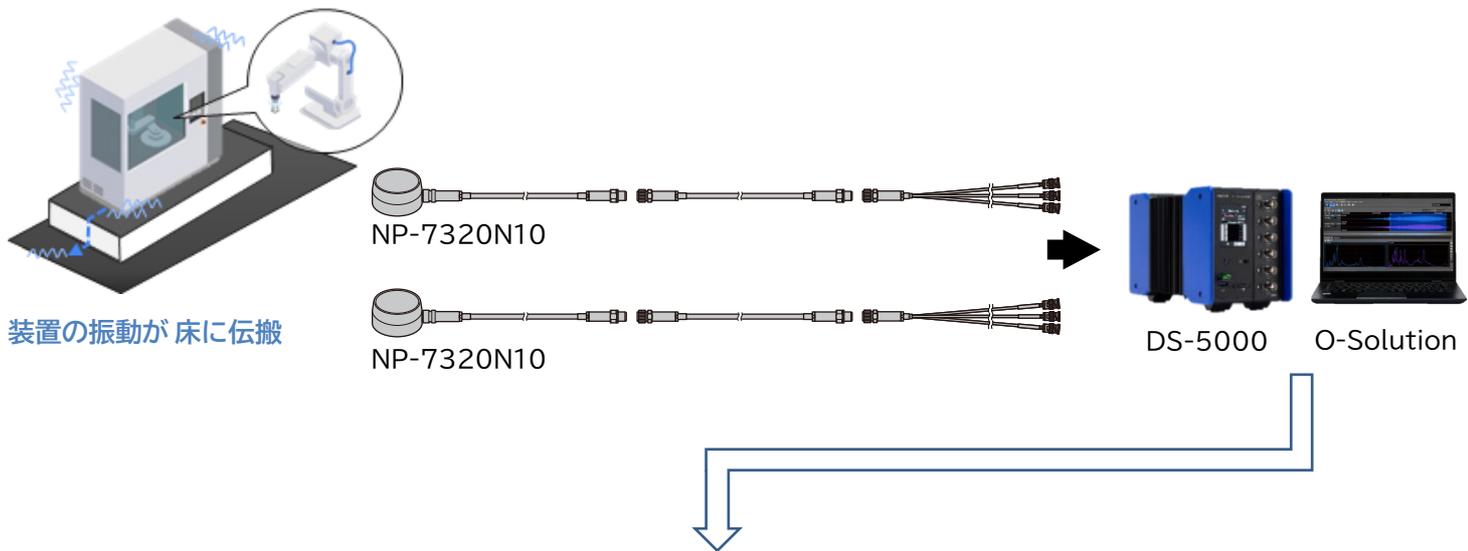
半導体製造装置や電子顕微鏡など、精密装置設置床に対する振動環境評価にはトリパタイトグラフとVC曲線を使うことが提唱されています。

床振動は、超高感度ローノイズTEDS対応3軸加速度センサーNP-7320N10を使用することで計測が可能です。

また、DS-5000・O-Solutionを使用することで多点同時測定と複数のVC曲線を表示できるので、効率良く床の状態を把握できます。

さらに設置床と装置の伝達特性を把握するなど、基本的な振動計測を同じシステムで実施することが可能です。

## ～計測～



## 複数のトリパタイトグラフを同時に表示・比較

